

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012年5月3日(03.05.2012)

PCT

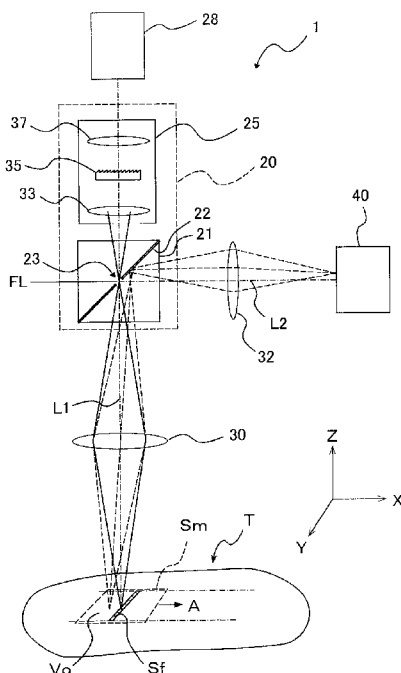
(10) 国際公開番号
WO 2012/057254 A1

- (51) 国際特許分類:
G01N 21/27 (2006.01) *G02B 5/04* (2006.01)
G01J 3/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/074783
- (22) 国際出願日: 2011年10月27日(27.10.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-243381 2010年10月29日(29.10.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三鷹光器株式会社(Mitaka Kohki Co., Ltd.) [JP/JP]; 〒1810014 東京都三鷹市野崎1-18-8 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山崎 登志夫(YAMAZAKI, Toshio) [JP/JP]; 〒1810002 東京都三鷹市牟礼 2-14-10-905 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))
- (74) 代理人: 三好 秀和, 外(MIYOSHI, Hidekazu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号 虎ノ門琴平タワー Tokyo (JP).

(54) Title: MONITORABLE SPECTROMETRIC MEASUREMENT DEVICE

(54) 発明の名称: モニター可能な分光計測装置

[図1]



(57) Abstract: A monitorable spectrometric measurement device is provided with a first optical path (L1) which extends from an object (Sm) to be measured to a spectrometer main body (25) through an optical system (30) and a slit section (23) of a slit-mirror block (21) and a second optical path (L2) which extends from the object (Sm) to be measured to a two-dimensional imaging unit (40) through the optical system (30) and a mirror face (22) of the slit-mirror block (21). The slit section (23) and the spectrometer main body (25) are integrated with each other to form a spectrometric unit (20).

(57) 要約: モニター可能な分光計測装置は、測定対象Smから光学系30、スリットミラーブロック21のスリット部23を介して分光器本体25に到る第1の光路L1と、測定対象Smから光学系30、スリットミラーブロック21の鏡面22を介して2次元撮像装置40に到る第2の光路L2が設けられる。スリット部23と分光器本体25は一体となって分光部20を構成する。